(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58-116165

f) Int. Cl.³B 41 J 3/04

i .

識別記号 103 庁内整理番号 7810-2C ❸公開 昭和58年(1983)7月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

タインク噴射ヘッド

②特 願 昭56-215330

②出 願 昭56(1981)12月29日

@発 明 者 杉谷博志

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2号キヤノン株式会社内

@発 明 者 松田弘人

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑫発 明 者 池田雅実

東京都大田区下丸子3丁目30番 2号キヤノン株式会社内

切出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2 号

個代 理 人 弁理士 丸島能一

男 編 書

1. 発明の名称

インタ吸射ヘッド

2. 特許請求の範囲

インク吐出圧発生素子を備えたインク通路の 1つに対し、近接した2以上のインク吐出孔を 配設して以ることを特徴とするインク噴射へっ ド。

3. 発明の評細な説明

本発明はインク噴射へ ッド、とりわけ、配像 用のインク痛を形成するのに適用されるインク 噴射へ ッドに関する。

一般に、インクと呼ぶ配録液を各種の方式 (例えば、静電吸引力を利用する方式や圧電素子の機械的振動を利用する方式等が知られている。)によって微細な吐出孔から噴出させてていまれてし、この小額を紙等の被配録面に付着させて記録を行なう所謂・インクジェット記録方式に於ては、とりわけ、印字品位を向上させる目 的から被配銀面に打ち込まれるインクドットの 特定を高めること(つまり、ドットが逃続して いる方が印字品位は良好である。)が重要を課 紙である。

しかしながら、従来に於ては、製造技術上の 割約から、高密度インクドットを形成し得るインク戦射へッドを得ることは極めて開業をこと アネッキ

本発明は、新かる従来技術の解決し得なかった課題を解決することを、目的とする。 換書 すれば、 本発明の主たる目的は、 高密度インクドット を安定して形成し得ると共に、 等型 でコンパクトに 構成されるインク 噴射ヘッドを提供することにある。

新かる目的を達成する本発明のインタッ射へ ッドは、インタ吐出圧発生素子を備えたインタ 通路の1つに対し、近接した2以上のインタ吐 出孔も配数して成ることを特徴にしている。

以下、図面を用いて本発明の実施例を詳細に説明する。

特開昭58-116165(2)

第1図(a),(b),(e)によって本発明の一実施例を示す..

第1図(a)は、一実施例としてのインク噴射へ ッドの外観斜視図であり、第1図(b),(c)は共に、 第1図(a)のX, X線に於ける切断面図である。

図に於て、1はガラス、セラミックス、ブラステック成は金属等から成る基板であり、との基本を1の片面には、発熱水子成は圧電水子等のインク吐出圧発生水子2が所望の個数[…第1図の別に戻ては2個の場合を例示してある」配設してある。図に、前記に、前記に、前記に、前記に、前記に、立て発熱水子が用いられるときより、インク吐出エネルギーとしてのインク吐出圧を発しての水子が、近傍のインクを加熱することにより、インク吐出エネルギーとしてのインク吐出圧を発生させる。又圧電水子が用いられるときは、この水子の機械的変位によってインク吐出圧を発生させる。尚、これ等の水子2には、図示されているように、近近年半導体工業でもちいられている510c, 81sNa, ポリイミド等の電気能量

度、互大に丘接して配設することも可能である。 又、これに加えて、インク吐出孔母に案子2 を対応させる様に変形することも可能である。 つまり、第1図(g)と阿様に、一つのインク室4 内に、インク吐出孔と同じ鉛数の互大に分解した ま子2を配数することも可能である。

膜とAl, Au 等の導覚膜を交互に被雇していく過 、程に於いて導電膜をフォトリングラフィによっ て所望の配線パターンにして構成する多層配線 技術等を利用することができる。

そして、3は基板1と同様の素材から成るス ペーサーであり、このスペーサー3の中央都を くり抜くことによって素子2の上方にインク富 4 が形成され、とのインク宝4内には基複1の 一部に設けた不図示の貫通孔を通してインク等 **管 5 よりインクが供給される様になっている。** 尚、前記導管ををスペーサー8の一部に接続さ せることもできる。又、導管をの数単価数も図 示例(1個)のみド限定されない。 6 は、その 厚さ方向に貫通したインク吐出孔74,7bを 設けた平板であり、これも前記基板1と同様の 集材から成るものである。そして前配したイン ク吐出孔7 a , 7 b は微細加工技術の許す綴り 近級させて記数するととができ、その偶数も属 示例に限定されるものではなく、(一つのイン 夕宝4に対して)3以上、何えば3個~5個個

次に、第2図(a) , (b) . (c)によって、別の実施 例を説明する。

第2 図(a) は、別の実施例としてのインタ噴射 ヘッドの外級針視図であり、第2 図(b) , (a) は共 に、第2 図(a) のY , Y線に於ける切断面照である。

図に於て、11は第1図の当板1に、12は 第1図のインク吐出圧発生来子2に、13は第 1図のスペーサー3に、14a,14b,14c,14d は何 れも第1図のインク室4に、15は第1図の等 管5に、16は第1図の平板6に、又、17a, 17b,17e,17d,17e,17f,17g,17h は何れも第1図 のインク吐出孔に夫々相当する構成要素であり、 各々の詳細は第1個に登いて説明されていると かりである。

尚、この部2図々示例に於ても、第1図々示例と同様に、各インク吐出孔17m,…,17mは、微細加工技術の許す限り近接させて図示の如く直線状若しくは不図示のジグザグ状に配数することができ、その個数も図示例に展定されるものではなく、(一つのインク線に対して) 8 以

特開昭58-116165(3)

上、例えば3個~5個程度、 与に近接して配設 することも可能である。

又、これに加えて、第1回本示例と阿様にインク吐出孔毎に分離された米子12を対応させる様に変形することも可能である。つまり、第2回(c)と阿様に、一つのインク室例えば14m内に、インク吐出孔と阿じ個数の互応分離した素子12を配数するととも可能である。

以上の様に構成されたインク度射へっドを不 図示の配触紙面にインク吐出孔 17a, …, 17a を設立させて対面させそのY, Y線と略直交する方、に近接した吐出孔 17a, …, 17bからちたた近地出孔 17a, …, 17bからちたとでする方、に近極した出孔の配触板にインクをといて、インリングでである。そして、各インクサースが極端をして、各インクドック配触板では、では、なり合うのインク険射へっドを用いたでは、では、特に接近のインク度対へ、不違統線では大く、特に接近なり、特に接近なり、特に対して、一つでは、特に対して、

- 3. しかも、インク吐出孔の高密度、微調加工 は比較的容易なことであるから、ヘッド自体 の製造を容易且つ歩留り良く行えことができ る。勢の効果が得られる。
- 4. 図面の16単な取明

は1図(a) , 銀1図(b) , 及び集1図(c) は、何れ 《本発明にはる一異施例の説明√であり、斜1図 (a) は、一実施例としてのインク喰射へットの外 観射視図、第1図(b) 及び第1図(c) は共に、第1 図(a) のX; X 触に於ける切断面図である。

第2回(a),第2回(b)及び第2回(c)は、何れも不発明に係る他の実施例の説明図であり、第2回(a)は長尺型インク噴射へ、ドの外観針視図、

新2図(b)及び解2図(c)は共に、第2図(a)のY。 Y製に戻ける切断面図である。

Mに於て、2,12はインク吐出圧発生業子、4,14a,14b,14c,14d,はインク室、7a,7b,17a,17b,17c,17d,17c,17f,17g,17bはインク吐出孔である。

連続線による印字を視覚することができるもの である。

又、第2図々示例の様々長尺へ、ド、例えば A 4 サイズの配修紙の様方向の長さとほど等長 のインク吐出孔列を偏えた長尺へ、ドを用いる場合には、走査回数が1回で済むので、第1個 々示例のヘッドを用いる場合に 敬べて印字所要時間をかなり短縮するととができる。

因に、第1図(c)又は第2図(c) に 於て 例示され た互に分離された 複数 個の インク吐出圧発生素 子2,12を作動させる方式としては、 同時又 は順次の何れの作動方式を採用しても良い。

以上の実施例によって説明したとおり、本発 明によれば、

- 1. 特に印字の縦方向に於て高密度に集積されるインクドットが形成できる為、従来にない 良品位の印字を得ることが可能である。
- 2. 又、インク吐出孔がインク吐出圧発生素子 に極近接して高密度に配列されている為、 難にしてコンパクトに構成できる。

特開昭58-116165(4)



